

【11】證書號數： M258100

【45】公告日： 中華民國 94 (2005) 年 03 月 01 日

【51】Int. Cl.⁷: C23C14/34

新型

全 8 頁

【54】名稱： 真空濺鍍腔體防著板調整機構

THE ADJUSTABLE MECHANISM OF THE SHIELDING PLATE IN
THE SPUTTERING VACUUM CHAMBER DESIGN

【21】申請案號： 093208667

【22】申請日期： 中華民國 93 (2004) 年06 月01 日

【72】創作人：

許耿禎

SHEU, GEENG JEN

【71】申請人：

修平技術學院

HSIUPING INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

臺中縣大里市工業路11號

【74】代理人：

1

2

[57]申請專利範圍：

1. 一種真空濺鍍腔體防著板調整機構，其係於真空腔體內左右兩側輪軸固定座之兩端各設有至少一調整機構，該調整機構包括：

一防著板，其設於托盤與輪軸固定座之間，可用以阻隔鍍膜分子直接沉積在真空腔體底部或傳輸機構表面上；

一彈性元件，其設於輪軸固定座所預設的一容置凹孔中，可用以推動

防著板的一端向上或向下移動；

一調整螺絲，其具有一螺紋部，該螺紋部上端有一螺絲頭，該調整螺絲係以螺紋部螺設於輪軸固定座所預設的螺孔上，該調整螺絲之螺絲頭位於防著板上方並卡住其一端，可藉由調整螺絲的轉動來調整防著板與托盤之間相對間隙(2 mm - 8mm)、傾斜角度及水平度。

10. 2.如申請專利範圍第1項之真空濺鍍腔

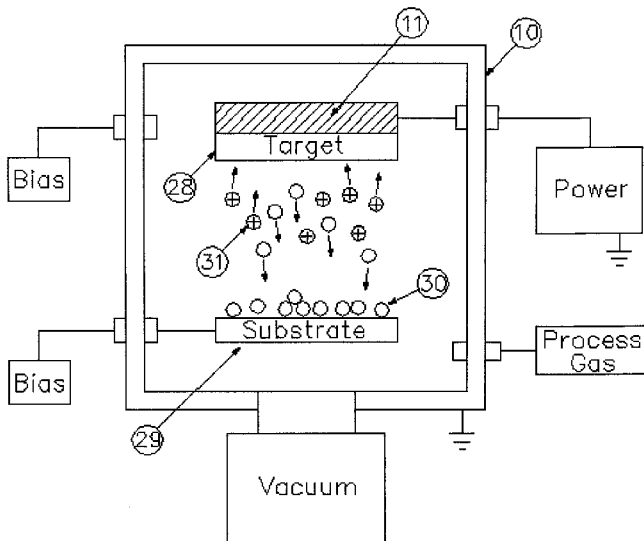
體防著板調整機構，其中防著板係由金屬材質所製成的薄板，其左右兩側可預設一些孔洞讓輪軸上的 O 型環穿過，其表面可加設一些加強肋來提升防著板強度及勁度。

- 3.如申請專利範圍第2項之真空濺鍍腔體防著板調整機構，其防著板是採用可拋棄式及可模組替換方式。
- 4.如申請專利範圍第1項之真空濺鍍腔體防著板調整機構，其中彈性元件係為彈簧或彈片。
- 5.如申請專利範圍第1項之真空濺鍍腔體防著板調整機構，其中調整螺絲上方螺絲頭設有一字槽、十字槽或六角形凹槽。
- 6.如申請專利範圍第1項之真空濺鍍腔體防著板調整機構，其可為至少四點式調整方式，即係於左右兩側輪

軸固定座之兩端各至少設有一調整機構，可調整防著板的位置、傾斜度及水平度。

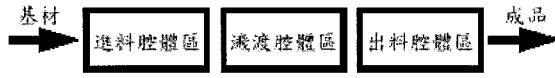
圖式簡單說明：

5. 圖一係真空濺鍍原理示意圖
- 圖二係習知連續式濺渡設備作業流程示意圖
- 圖三係習知無防著板設計之真空腔體立體分解圖
10. 圖四係習知無防著板設計之真空腔體剖面示意圖
- 圖五係習知具固定式防著板設計之真空腔體立體分解圖
- 圖六係習知具固定式防著板設計之真空腔體剖面示意圖
15. 圖七係本創作之立體分解圖
- 圖八係本創作之剖面圖

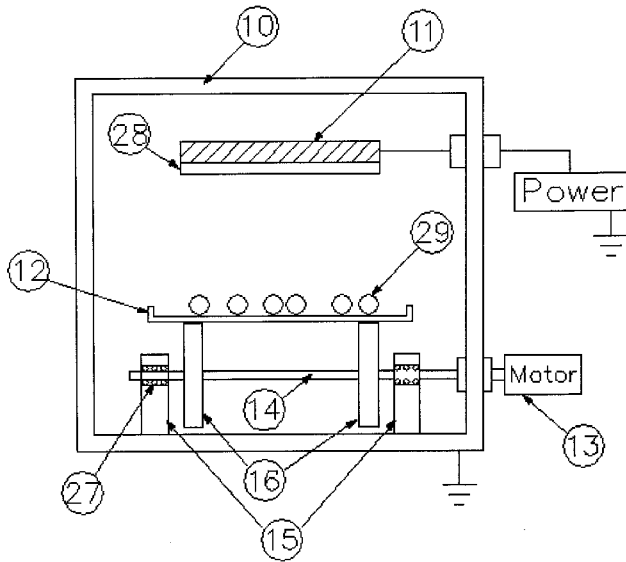


圖一

(3)

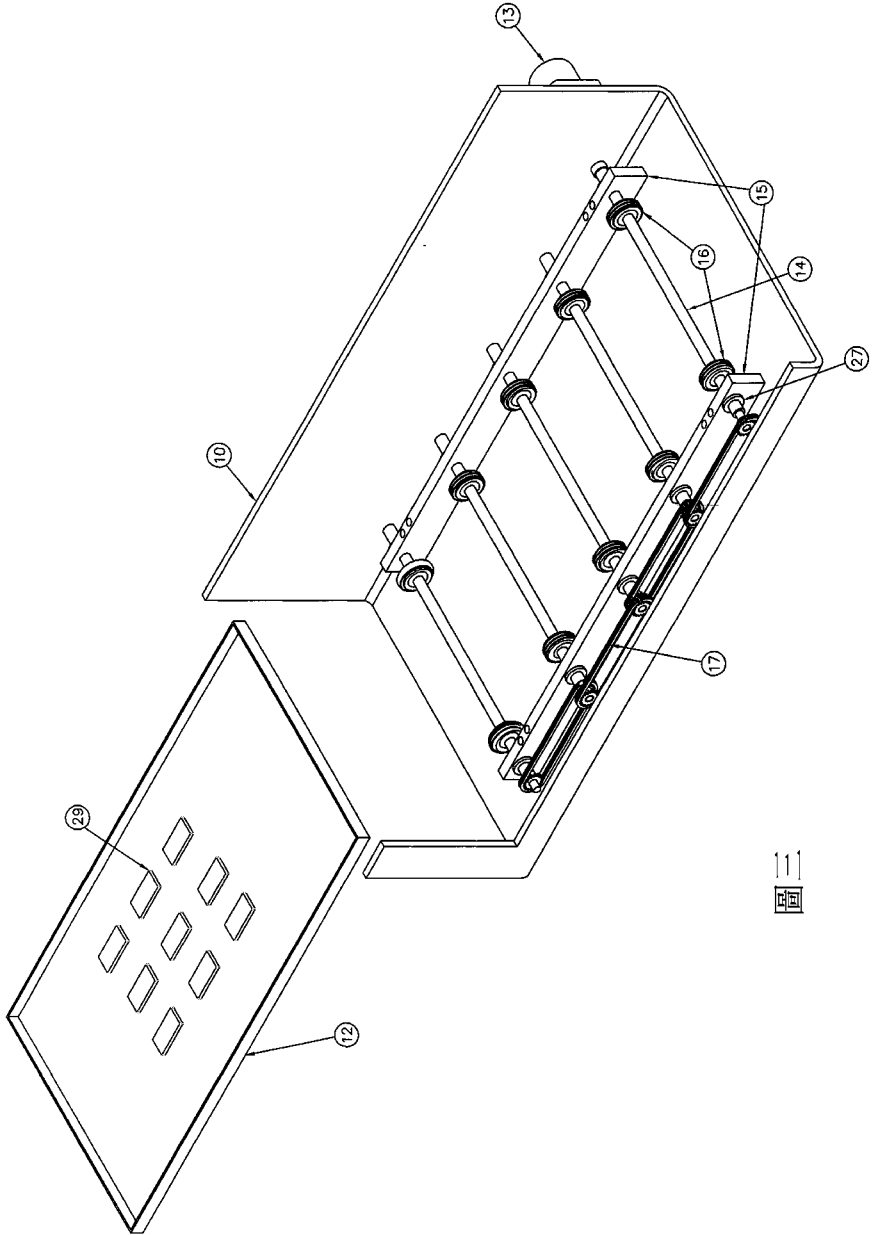


圖二

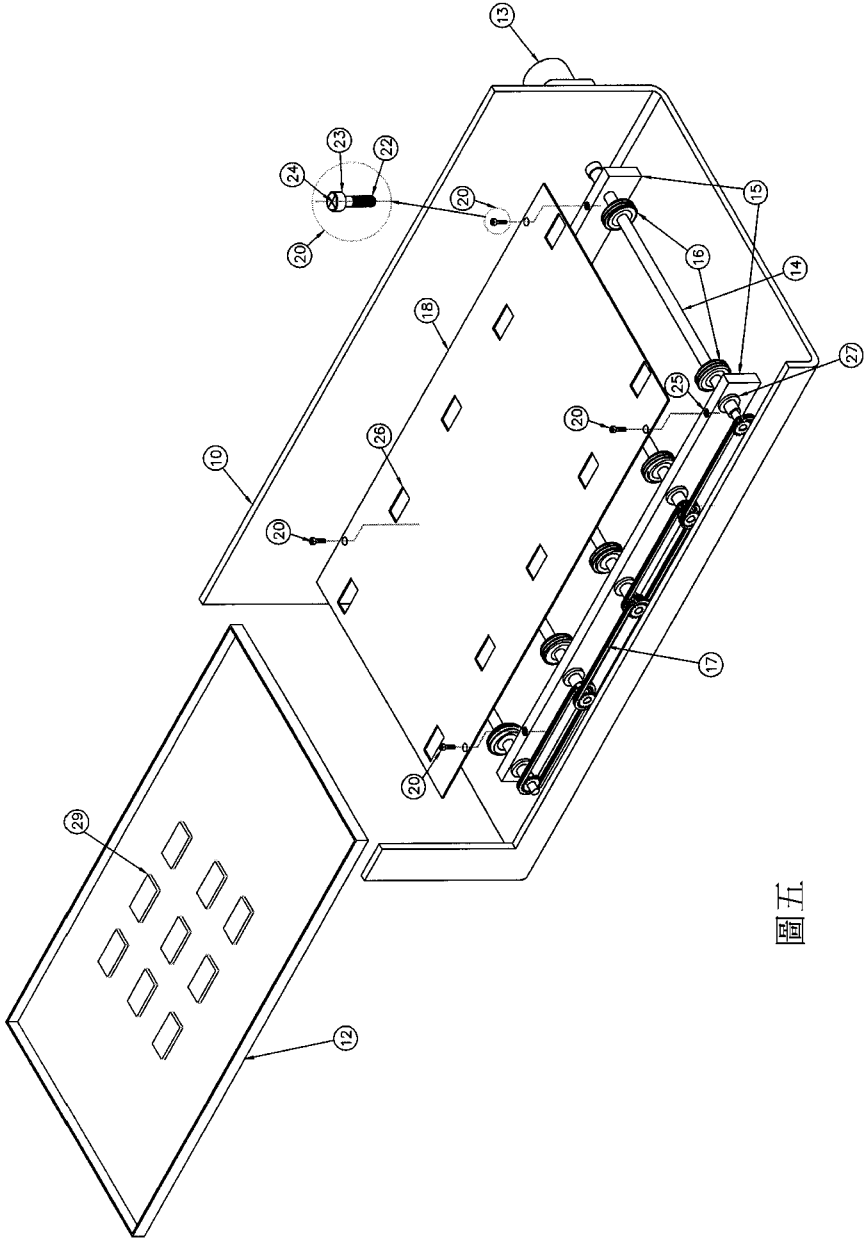


圖四

(4)

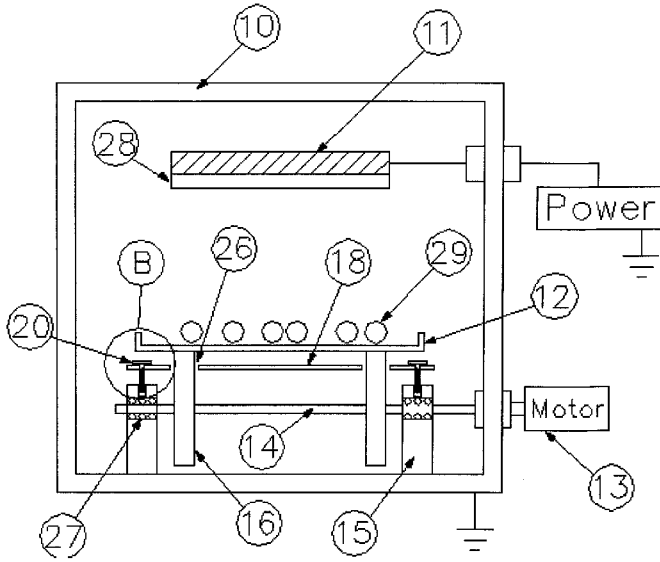


(5)

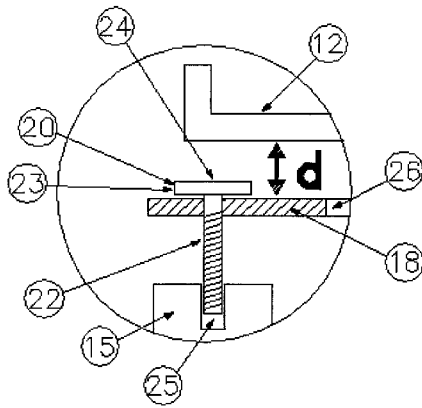


圖五

(6)

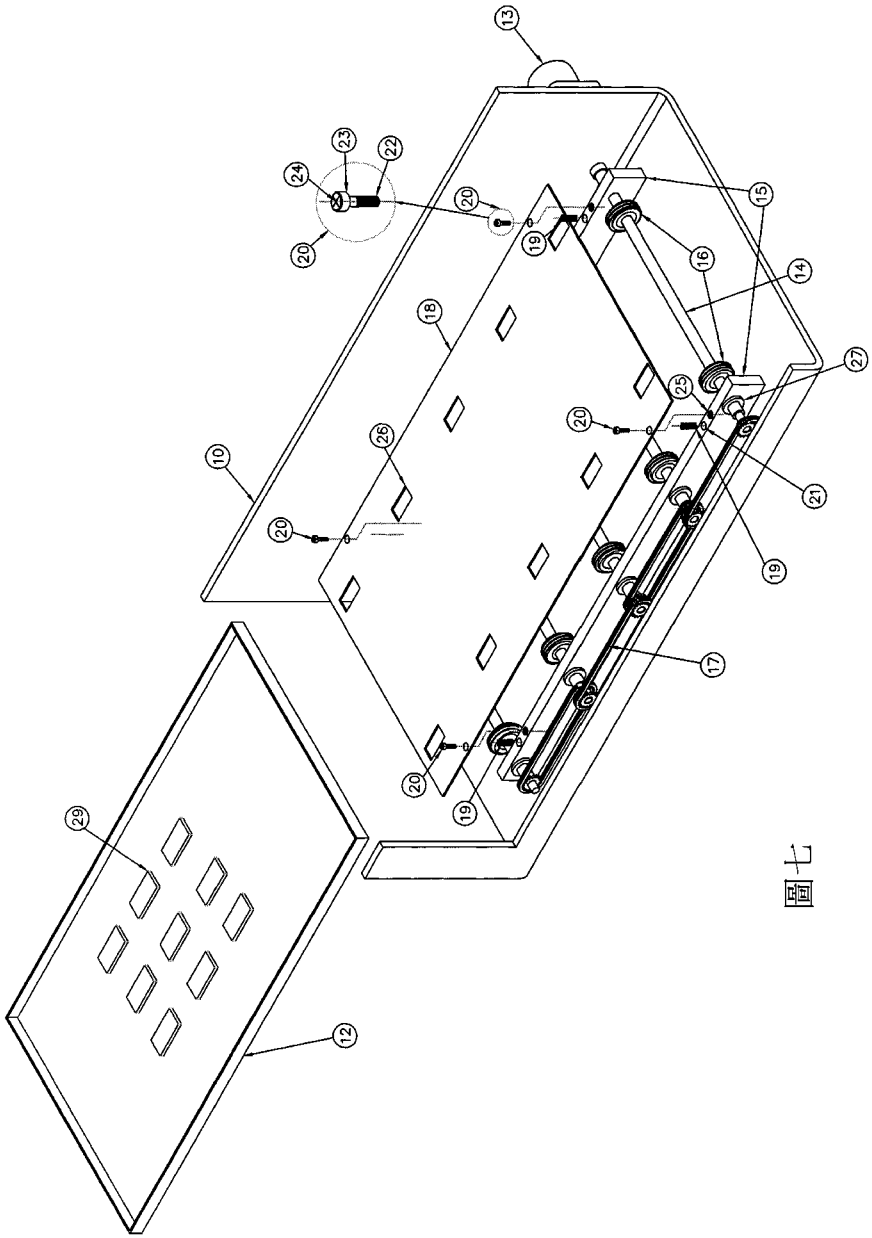


B 放大圖



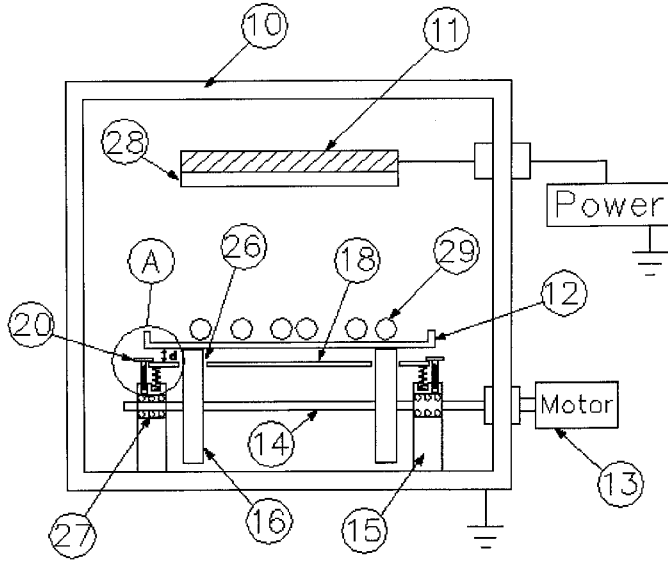
圖六

(7)

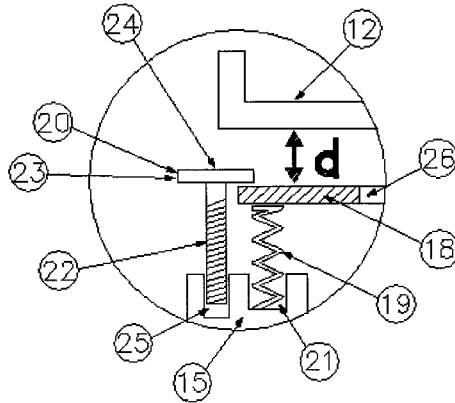


圖七

(8)



A 放大圖



圖八